This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

10326572 A

(43) Date of publication of application: 08.12.98

(51) Int. CI

H01J 11/02 H01J 9/39 H01J 9/40

H01J 17/18 H01J 17/22

(21) Application number: 09136965

(71) Applicant:

CHUGAI RO CO LTD

(22) Date of filing: 27.05.97

(72) Inventor:

SEKI TADASHI

SHIMOZATO YOSHIKAZU

(54) MANUFACTURE OF PLASMA DISPLAY PANEL

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To manufacture a plasma display panel in which the pressure of internal discharge gas is constant.

SOLUTION: A plasma display is manufactured in such a way that a plasma display panel assembly T comprising a front glass substrate 1 and a back glass substrate 3 is placed in a sealed space, the space is evacuated in vacuum, discharge gas is supplied to the space, then the plasma display assembly T is sealed. In this manufacturing process, a ventilation hole 2 is formed in one of the glass substrates, the plasma display panel assembly T is sealed, then the ventilation hole is sealed with a sealing glass plate 8.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-326572

(43)公開日 平成10年(1998)12月8日

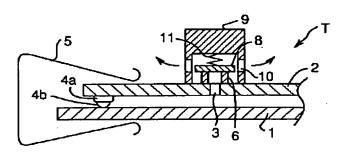
(5i) Int Cl. の												
B 9/39 A 9/40 A 17/18 **査請求 未請求 請求項の数 2 OL (全 5 頁) 最終頁に続く (21)出願番号 特願平9-136965 (71)出願人 000211123 中外炉工業株式会社 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号 (72)発明者 関 忠 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号 中外炉工業株式会社内 (72)発明者 下里 吉計 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号 中外炉工業株式会社内 (72)発明者 下里 吉計 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号 中外炉工業株式会社内 (72)発明者 下里 吉計 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号 中外炉工業株式会社内 (72)発明者 下里 古計 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号 中外炉工業株式会社内 (72)発明者 下里 古計 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号 中外炉工業株式会社内 (72)発明者 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	(51) Int.Cl. ⁶		識別記号		FI		-					
9/39 9/40 9/40 A 17/18 第全請求 未請求 請求項の数 2 OL (全 5 頁) 最終頁に続く (21)出願番号 特願平9-136965 (71)出願人 000211123 中外炉工業株式会社 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号 (72)発明者 関 忠 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号 中外炉工業株式会社内 (72)発明者 下里 吉計 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号 中外炉工業株式会社内	H01J	11/02			H0	1 J 1	1/02			D		
9/40 A 17/18										В		
17/18 審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 5 頁) 最終頁に続く (21)出願番号 特願平9-136965 (71)出願人 000211123 中外炉工業株式会社 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号 (72)発明者 関 忠 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号 中外炉工業株式会社内 (72)発明者 下里 吉計 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号 中外炉工業株式会社内 (72)発明者 下里 吉計 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号 中外炉工業株式会社内 (72)発明者 下里 古計 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号 中外炉工業株式会社内 (72)発明者 下里 古計 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号 中外炉工業株式会社内 (72)発明者 (73)発明者 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号 中外炉工業株式会社内		9/39			•							
審査請求 未請求 請求項の数 2 OL (全 5 頁) 最終頁に続く (21)出願番号 特願平9-136965 (71)出願人 000211123 中外炉工業株式会社 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号 (72)発明者 関 忠 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号 中外炉工業株式会社内 (72)発明者 下里 吉計 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号 中外炉工業株式会社内		9/40										
(21) 出願番号 特願平9-136965 (71) 出願人 000211123 中外炉工業株式会社 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号 (72)発明者 関 忠 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号中外炉工業株式会社内 (72)発明者 下里 吉計 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号中外炉工業株式会社内	1	17/18				. 1	7/18					
中外炉工業株式会社 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号 (72)発明者 関 忠 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号 中外炉工業株式会社内 (72)発明者 下里 吉計 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号 中外炉工業株式会社内				審査請求	未請求	請求項	質の数 2	OL	(全	5 頁)	最終頁に続く	
(72)発明者 関 忠 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号中外炉工業株式会社内 (72)発明者 下里 吉計 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号中外炉工業株式会社内	(21)出願番号		特願平9-136965		(71)	出願人						
大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号 中外炉工業株式会社内	(22)出顧日		平成9年(1997)5月27日		(72)	発明者	大阪府 関 忠 大阪府	大阪市 大阪市	西区京 西区京	町堀2 町堀2		
(74)代理人 弁理士 青山 葆 (外3名)					(72)	発明者	大阪府	大阪市			丁目4番7号	
					(74)	代理人	弁理士	青山	葆	少 13	名)	
				•	ļ							

(54) 【発明の名称】 プラズマディスプレイパネルの製造方法

(57)【要約】

【課題】 内部放電ガス圧の一定したPDPを製造する。

【解決手段】 前面ガラス基板1と背面ガラス基板3とからなるプラズマディスプレイパネル組立体Tを密閉空間に位置させて、当該空間を真空排気したのち放電ガスを前記空間に供給し、その後、前記プラズマディスプレイパネル組立体を封着するプラズマディスプレイパネルを製造するにあたり、前記ガラス基板の一方に通気孔2を設けたものを使用してプラズマディスプレイパネル組立体を封着したのち、前記通気孔をシールガラス板8により封止するプラズマディスプレイパネルの製造方法。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 前面ガラス基板と背面ガラス基板とから なるプラズマディスプレイパネル組立体を密閉空間に位 置させて、当該空間を真空排気したのち放電ガスを前記 空間に供給し、その後、前記プラズマディスプレイパネ ル組立体を封着するプラズマディスプレイパネルの製造 方法において、

前記ガラス基板の一方に通気孔を設けたものを使用して プラズマディスプレイパネル組立体を封着したのち、前 記通気孔を封止することを特徴とするプラズマディスプ 10 レイパネルの製造方法。

【請求項2】 前記通気孔を介してゲッタ材をプラズマ ディスプレイパネル組立体内に位置させて封着したの ち、前記通気孔を封止することを特徴とする前記請求項 1に記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。

【発明の詳細な説明】、

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プラズマディスプ レイパネル(以下、PDPという)の製造方法に関する ものである。

[0002]

【従来の技術】PDPの製造方法として種々の方法が提 案されているが、その1つとして、図6,7に示すよう に、前面ガラス基板1と背面ガラス基板2との対向面に 従来同様、電極 (図示せず) および隔壁2aを設け、両 ガラス基板1,2のうち、たとえば背面ガラス基板2の 前記対向面の外周部に低融点ガラス等のシール用封着材 4 a をディスペンサー等で塗布し、さらにその上にスペ ーサ用封着材4bを所定間隔にて設けたのち乾燥し、こ の背面ガラス基板2と前面ガラス基板1をクランプ金具 30 5にて固定してPDP組立体Tとする。そして、このP DP組立体Tを密閉炉内に装入して300~400℃に 加熱するとともに炉内を排気することで、同時に両ガラ ス基板 1, 2の脱ガスを行なう。この場合、炉の昇温速 度は3~15℃/分、排気は10⁻⁶~10⁻⁷Torr程 度とする。前記のようにして、炉内を所定真空度として 炉内排気と両ガラス基板1,2からの脱ガスが完了する と、炉内に、たとえば、ネオンガス等の放電ガスを供給 (所期の封入ガス圧を得るのに必要な量) することで、 ガラス基板間に放電ガスを導入する。その後、さらに炉 40 内温度を封着材 4 a , 4 b の軟化温度である 4 0 0 ~ 5 00℃に上昇させて前記封着材を軟化させて封着処理し て両ガラス基板1,2内に放電ガスを封入することで、 PDPとするものである。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】前記方法でPDPを製 造したところ、PDP内の放電ガスの封入ガス圧に±1 0%以上のバラツキがあり、種々支障を来すことが判明 した。そこで、本発明者らは、その原因につき検討した ところ、下記理由によることを知見した。すなわち、前 50 いて図にもとづいて説明する。本発明の第1の実施の形

記両ガラス基板1,2はその外縁部に設けたスペーサ用 封着材4bにより内外が連通状態であることから、炉内 温度の上昇につれて封着材4a,4bが軟化し、封着材 4 a, 4 b が両ガラス基板 1, 2 の対向外縁部を封止す る瞬間におけるPDPの内外の圧力は同一である。この 時の両ガラス基板1,2間の隙間Dは、封着材4a、4 bの塗布状態により決定される。その後、炉内温度をさ らに上昇させると封着材4a,4bの軟化がさらに進行 するとともに、クランプ金具5による押圧力により両ガ ラス基板1,2が封着され、両ガラス基板1,2間の距 離が所期の隙間 d (封着完了時の封着材 4 の厚み) とな る。つまり、前述のように、両ガラス基板1,2の外縁 部が封止された後、その間隙は所定値まで減少する (D →d) ため、PDP内の封入ガス圧P₁' は両ガラス基 板1,2の外縁部内の面積をS、放電ガス供給完了時の 炉内圧をP1とすると、P1×D×S=P1'×d×S

∴ $P_1' = P_1 (D/d)$ となる。ここで、D=2 00μ , $d = 150\mu$, $P_1 = 500 \text{ Torr}$ とする と、P₁'=667Torr となり、PDP内の封入 20 ガス圧が大きく変化する。

【0004】また、封着材4a,4bは前述のようにデ ィスペンサー等で形成されるが、その量および形状を完 全に同一にすることは不可能であるから、両ガラス基板 1,2が封止する瞬間の隙間Dを正確に制御することが できない。このため、封着材4a、4bによる両ガラス 基板1,2の封止開始時からの押込量が一定とならない ため、予め押込量に見合ったガス圧力を導入してPDP 内の封入ガス圧を一定にすることができないことに起因 することを知見した。したがって、本発明は、封着材の 形成状態に関係なく、常に、PDP内の放電ガスの封入 ガス圧を一定とすることのできるPDPの製造方法を提 供することを第1目的とする。また、前記方法を実施す るにあたり、ゲッタ材を活性化するゲッタ付きPDPの 製造方法を提供することを第2目的とする。

【課題を解決するための手段】本発明は、前記目的を達 成するために、前面ガラス基板と背面ガラス基板とから なるプラズマディスプレイパネル組立体を密閉空間に位 置させて、当該空間を真空排気したのち放電ガスを前記 空間に供給し、その後、前記プラズマディスプレイパネ ル組立体を封着するプラズマディスプレイパネルの製造 方法において、前記ガラス基板の一方に通気孔を設けた ものを使用してプラズマディスプレイパネル組立体を封 着したのち、前記通気孔を封止するものである。また、 前記通気孔を介してゲッタ材をプラズマディスプレイパ ネル組立体内に位置させて封着したのち、前記通気孔を 封止するものである。

[0006]

【発明の実施の形態】つぎに、本発明の実施の態様につ

態は、前記前面ガラス基板1あるいは背面ガラス基板2 のいずれか一方のガラス基板に通気孔3を設けたものを 使用し、この両ガラス基板1,2からなるPDP組立体 Tを封着したのち、前記通気孔3を封止するようにした ものである。

【0007】すなわち、図1に示すように、たとえば、背面ガラス基板2のシール用封着材塗布部よりやや内方に通気孔3を設け、この通気孔3を囲むように、低融点ガラスからなる最終封着材6を位置させる。この最終封着材6は前記シール用、スペース用封着材4a,4bよ 10り軟化点が高い材料により成型したもので、図2

(A), (B)に示すようにC形状や側壁に溝を形成したリング形状をし、前者の開口、後者の溝をガス流通孔7としたものである。表面ガラス基板1と背面ガラス基板2とは、背面ガラス基板2の外縁部にシール用、スペース用封着材4a,4bを塗布して乾燥・仮焼成した後、クランプ金具5により背面ガラス基板2を上側として組付けてPDP組立体Tとする。このPDP組立体Tの内外は連通状態となっている。なお、シール用、スペース用封着材4a,4bとしては、たとえば日本電気硝20子(株)製LS-0118…軟化点390℃、最終封着材6としては、たとえば同社製LS-0206…軟化点410℃などが使用できる。

【0008】ついで、前記最終封着材6上にシールガラス板8を載置するとともに、背面ガラス基板2上にステンレス鋼等からなる組付治具9を載置し、この組付治具9との間に介在したスプリング11により前記シールガラス板8を最終封着材6に圧着した状態とする。そして、密閉炉内に装入して図3のヒートカーブにしたがって、340~370℃に加熱するとともに炉内を排気す30ることで、同時に両ガラス基板1,2の脱ガスを行なう。この場合、炉の昇温速度は約3℃/分、排気は10~370℃で一定時間均熱して前記両ガラス基板1,2の脱ガスを確実に行なう。前記のようにして、炉内を所定真空度とし炉内排気と両ガラス基板1,2からの脱ガスが完了すると、炉内を410~470℃に再昇温する。

【0009】一方、炉内空間に、たとえば、ネオンガス等の放電ガスを前記均熱中の後半(脱ガスの完了時点)で導入する。この放電ガスは、加熱されて温度が高いた 40め、PDPの常温における所定圧力を保持する必要上、たとえば450℃においては常温時の所定圧力(放電ガスの封入ガス圧)の約2.4倍の圧力とする必要がある。

【0010】ところで、前記封着材4a, 4bは図3の A点にて軟化を開始して両ガラス基板1, 2の外縁部は 封止される。この瞬間の両ガラス基板1, 2内の圧力P1と炉内圧 P_2 とは同じである($P_1=P_2$)。その後、炉 内温度の昇温により前記封着材4a, 4bはさらに軟化 するとともに、クランプ金具5により押圧され、B点で 50

両ガラス基板 1, 2間の隙間が減少する (Dから d)。この際、前記最終封着材 6 は軟化点が封着材 4 a, 4 b より高いため非軟化状態であるから、前記両ガラス基板 1, 2間の隙間がDから dへと減少して両ガラス基板 1, 2間の内圧が大になろうとしても最終封着材 6 のガス流通孔 7、組付治具 9 の通気孔 1 0 から両ガラス基板 1, 2間の圧力が炉内へ逃げて同圧に維持される ($P_1 = P_2$)。

【0011】その後、C点において、前記最終封着材6が軟化し、前記シールガラス板8はスプリング11の押圧力で通気孔3を封止することになる。なお、この場合においても最終封着材6は軟化してガス流通孔7を閉鎖した後、さらに軟化して押圧されるため、若干ガラス基板1,2内の圧力は大となるが、その容積変化は全体からみれば極めて小さく無視することができる。つまり、放電ガスは炉内圧P₂とほぼ同一の状態で両ガラス基板1,2間に対入される。前記のようにしてガラス基板1,2間に放電ガスが封入されると、約3.5℃/分の冷却速度で冷却して所定のPDPとする。

【0012】前記のガス導入例は340~370℃の脱ガス均熱後に発光ガスを導入した例であるが、下記方法をとってもよい。340~370℃での真空脱ガス後、真空排気をそのまま続行しつつ炉を昇温させ、基板シール材4a,4bの軟化開始温度Aと最終シール材6の封止温度Cの温度範囲で放電ガスを密閉炉内にガスを導入する。この方法では、炉内に導入された放電ガスは、組付治具9の通気孔10、最終封着材6のガス流通孔7からPDP内に侵入する。

【0013】前記PDP内への封入ガス(放電ガス)は 出来るだけ不純物 (N₂, O₂, H₂, CO, CO₂等) が 少ないことが望ましい。このため、図4に示すように、 PDP内にゲッタ材を設けて前記不純物を除去する方法 がある。この場合、前記通気孔3をゲッタルームの一部 として利用するとともに、前記封着材 4 a , 4 b の封着 温度をゲッタ材12の活性化処理温度に利用することが できる。すなわち、PDP組立体Tを構成する過程にお いて、ゲッタ材 (たとえば、サエス ゲッターズ ジャ パン (株) 製Pt707…活性化温度400~500 ℃) 12を背面ガラス基板2に設けた通気孔3内に位置 するようにしてPDP組立体Tを構成し、前述のヒート カーブにより封着処理を行なえば、最終封着温度(41 0~470℃) において前記ゲッタ12は活性化され、 PDP内の放電ガス中の不純ガスを吸着することにな る。なお、最終封着材6は、図5に示すように、シール 用封着材 6 a とスペース用封着材 6 b で構成されてい

【0014】PDP組立体Tにおける両ガラス基板1, 2の隙間形成は、前記実施形態に限らず、実質的に隙間 が形成されるのであれば、他の方法を採用してもよい。

[0015]

5

【発明の効果】以上の説明で明らかなように、請求項1 の発明によれば、前面ガラス基板と背面ガラス基板とか らなるプラズマディスプレイパネル組立体を密閉空間に 位置させて、当該空間を真空排気したのち放電ガスを前 記空間に供給し、その後、前記プラズマディスプレイパ ネル組立体を封着するプラズマディスプレイパネルの製 造方法において、前記ガラス基板の一方に通気孔を設け たものを使用してプラズマディスプレイパネル組立体を 封着したのち、前記通気孔を封止するようにしたから、 つまり、両ガラス基板が完全に封着されたのちに通気孔 10 が封止されるため、PDP内の放電ガス圧は炉内に供給 される放電ガス圧により制御でき、放電ガス圧のほぼ均 ーなPDPとすることができる。また、請求項2の発明 によれば、前記通気孔を介してゲッタ材をプラズマディ スプレイパネル組立体内に位置させて封着したのち、前 記通気孔を封止するようにしたから通気孔をゲッタルー

ムとして利用できるとともに、通気孔の封止温度をゲッ

タの活性化温度に利用することができるという効果を奏

する。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明のプラズマディスプレイパネルの製造に適用する組立体の一部断面図。

6

【図2】 (A), (B) は最終封着材の斜視図。

【図3】 ヒートカープ。

【図4】 他の組立体の断面図。

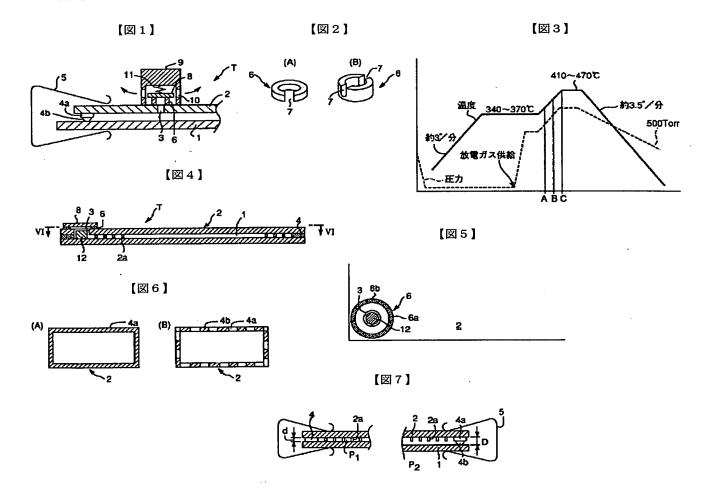
【図5】 図4のV-V平面図。

【図6】 (A), (B) はガラス基板上への封着材の) 塗布方法を示す図。

【図7】 従来のプラズマディスプレイパネルの製造に 適用される組立体の一部断面図で、左半分は封着後、右 半分は封着前を示す。

【符号の説明】

1…前面ガラス基板、2…背面ガラス基板、3…通気 孔、4 a, 4 b…封着材、5…クリップ金具、6…最終 封着材、8…シールガラス板、T…プラズマディスプレ イパネル組立体。



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ

HO1J 17/22

H 0 1 J 17/22